



# Advanced Thin Film Technologies

Dr. Detlef Theirich

WS 2024/2025

Infos auch auf unserer WEB-Seite [www.lfeb.uni-wuppertal.de](http://www.lfeb.uni-wuppertal.de) unter Lehre

**Beginn:** Dienstag 15.10.2024 um 14:15 Uhr in FG-01.01

**Zeit / Ort:** Vorlesung/Übung/Seminar: Dienstag 14.15 – 17.45 Uhr  
voraussichtlich Seminarraum FG-01.01

*Die Zeiten können ggf. noch in Absprache mit den Teilnehmern modifiziert werden.*

**Zielgruppe:** Studierende des **Masters Elektrotechnik**  
Vertiefungsrichtung: Polymer Electronics and Novel Technologies  
Bereich: Materials and Processes.

Studierende des **Masters Wirtschaftsingenieurwesen / Energiemanagement**  
Wahlpflichtbereich Energiemanagement 2 / Energietechnische Systeme  
und Komponenten

Studierende des **Masters Wirtschaftsingenieurwesen / Informationstechnik**  
Wahlpflichtbereich Elektronik

Studierende des **Masters Maschinenbau**  
Wahlpflichtbereich Materialwissenschaften und Werkstofftechnik

Students of the **Master Smart Materials and System**  
Specialisation area Materials and Fundamentals

**Inhalte:** Einführung / Wiederholungen  
Plasma  
Ausgewählte plasmagestützte Abscheidungsverfahren (Sputtern, reaktives Sputtern,  
CVD, Plasma-CVD, ALD, Plasma-ALD)  
Schichteigenschaften und Prozesseinflüsse  
Ausgewählte Methoden zur Schichtcharakterisierung  
Industrielle Anlagen und Anwendungsbeispiele

**Seminar:** Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in der Vorlesung

gez. Dr. Detlef Theirich